

デモラインご活用ください 蒸着装置

Model : ei-5

◆研究開発から少量生産向けモデル 基板上に金属を成膜

特徴

- 2009年製装置をリファービッシュ
- 1GUN,2GUN (Co-Depo)仕様あり
- 自公転、公転治具
- プログラム(多層膜)成膜対応
- プロセスデータ ロギング機能対応
- メタル全般に対応※

※基板と蒸着材料は御支給ください



構成

項目	構成
Type	Batch式
加熱機構	Lamp Heater MAX : 350°C
蒸着方式	EB-Gun
EB-Gun型式	EGL-406M
膜厚計	CRTM-R1、CRTM-9000
蒸発源距離(Hearth~公転治具)	595.5mm
Dome	公転 or Planetary
対応基板	公転6inch、Planetary5,6,8inch基板
治具回転SPEED	5~12r/min
真空Pump	DRP/CP

ご相談ください

- 成膜試作、検証
- 現象解析
- 操作性確認
- 中古機導入検討

ご相談はアルバックテクノへ



ei-5_1.4

ULVAC